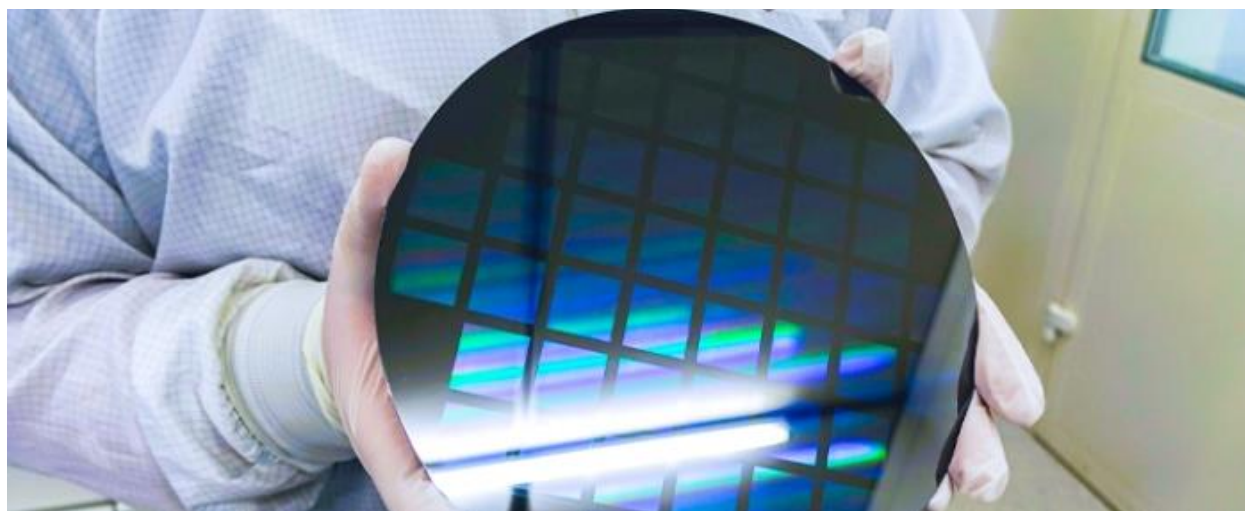




**Silicon Austria Labs instaluje nowe systemy EVG – November 15, 2023**



Biznes | 15 listopada 2023

### **Silicon Austria Labs instaluje nowe systemy EVG**

**Wiodące austriackie centrum badawcze Silicon Austria Labs (SAL) zainstalowało systemy litografii i przetwarzania rezystancji EV Group (EVG) w swoim ośrodku MicroFab R&D w Villach w Austrii.**

Instalacje te stanowią jeden z elementów rozszerzonej współpracy między obiema firmami, mającej na celu przyspieszenie rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii optycznych dla heterogenicznych zastosowań integracyjnych, w tym optyki na poziomie wafla.

Nowo zainstalowane systemy EVG obejmują bezmaskowy system naświetlania LITHOSCALE, zautomatyzowany system nanoimprint SmartNIL EVG 7300 i system optyki na poziomie wafla, a także wiele uzupełniających systemów przetwarzania rezystancji. Systemy te dołączają do istniejącej bazy zainstalowanych przez SAL wielu systemów EVG do klejenia, wyrównywania masek i litografii, w tym pierwszej instalacji 200-mm wersji zautomatyzowanego systemu przetwarzania rezystancji EVG 150.

*"Niedawno zaangażowaliśmy się w szereg najnowocześniejszych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących meta-optykę, zintegrowaną fotonikę i MEMS, wymagających użycia zaawansowanych narzędzi do litografii i klejenia. Dzięki naszej cenionej współpracy z EVG uzyskaliśmy dostęp do narzędzi o wyjątkowej niezawodności i precyzji, które mają kluczowe znaczenie dla udanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. W szczególności system EVG 7300 SmartNIL stał się kluczowym narzędziem umożliwiającym masową produkcję nanostruktur dla nowych urządzeń fonicznych i MEMS. Jego zastosowania obejmują różnorodne dziedziny, takie jak inteligentne systemy oświetleniowe, AR/VR, optyka samochodowa, telekomunikacja i technologia kwantowa" – mówi dr Mohssen Moridi, szef działu badawczego Microsystems w Silicon Austria Labs w komunikacie prasowym.*

SAL był jednym z pierwszych klientów, którzy otrzymali nowy system EVG7300, będący jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań EVG łączącym wiele możliwości procesowych opartych na UV, takich jak litografia nanoimprint (NIL), formowanie soczewek i układanie soczewek (klejenie UV) w jednej platformie. EVG7300 został opracowany specjalnie w celu zaspokojenia zaawansowanych potrzeb badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.

*"Ta najnowsza dostawa i instalacja naszych zaawansowanych systemów litografii i przetwarzania rezystancji jeszcze bardziej wzmocnia nasze relacje i wspiera zdolność SAL do opracowywania przyszłych kluczowych technologii i stosowania naszych wiodących rozwiązań w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych" – dodaje Thomas Glinsner, dyrektor ds. technologii korporacyjnych w EV Group.*

<https://evertiq.pl/news/31633>